(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月14日(14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/034045 A1

(51) 国際特許分類7:

G07C 3/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014340

(22) 国際出願日:

2004年9月30日(30.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2003年10月3日(03.10.2003) ТР 特願2003-345772

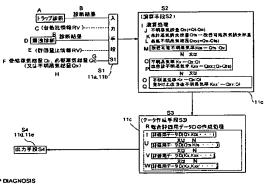
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社テイエルブイ (TLV CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6758511 兵庫県加古川市野口町長砂881番地 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原良康 (FU-JIWARA, Yoshiyasu) [JP/JP]; 〒6758511 兵庫県加古川 市野口町長砂881番地 株式会社テイエルブイ内 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 北村修一郎 (KITAMURA, Shuichiro); 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎五丁目 8 番 1 号 Osaka
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続葉有/

(54) Title: FACILITY DIAGNOSIS METHOD, FACILITY DIAGNOSIS CALCULATION SYSTEM OPERATION METHOD, AND FACILITY DIAGNOSIS CALCULATION SYSTEM

(54) 発明の名称: 設備診断方法、設備診断用集計システムの動作方法、並びに、設備診断用集計システム



- DAGANOSIS NESSLI (
 KNUMBER-OF-DEVICES RATIO INFORMATION RV)
 LEAK DIAGNOSIS
 (EVALUATION AMOUNT RATIO INFORMATION RV)
 TOTAL VAPOR SUPPLY AMOUNT G:
- TOTAL NECESSARY VAPOR AMOUNT Qo (OR TOTAL UNKNOWN VAPOR AMOUNT Qx)

- INPUT MEANS OUTPUT MEANS (CALCULATION MEANS)
- CALCULATION PROCESSING
 TOTAL UNKNOWN VAPOR AMOUNT CXI*G*G)
 TOTAL VAPOR LOSS AMOUNT QTS -- TOTAL IMPROVABLE
 VAPOR LOSS AMOUNT QTS -- TOTAL IMPROVABLE
- パー いっこう MRIUUNI TOTAL BASIC UNKNOWN VAPOR AMOUNT Oxc(*Ox-Ots)
 RATIO OF IMPROVABLE UNKNOWN VAPOR RATIO は つち なつ
 のR
 UNKNOWN VAPOR RATIO は一から

- RATIO OF UNKNOWN VAPOR RATIO AFTER
- IMPROVEMENT Kxx Oct (CI-Ota)
 APPARENT RATIO OF UNKNOWN VAPOR AFTER
 IMPROVEMENT Kxx Oct Oc
- (DATA CREATION MEANS)
- PROCESSING FOR CREATING DATA D FOR OVERALL EVALUATION EVALUATION DATA D (OX.IOS....)
- EVALUATION DATA D (QIS, KIS)
- EVALUATION DATA D (KI,KIL...)
- EVALUATION DATA D IKKKO: · · · I

(57) Abstract: There are provided a facility diagnosis method, a facility diagnosis calculation system operation method, and a facility diagnosis calculation system which are appropriate for evaluating the efficiency of the facility improvement. According to the total vapor supply amount Qi and the total necessary vapor amount Qo and the total vapor loss which can be eliminated as a total improvable vapor loss amount by a predetermined facility improvement, it is possible to calculate the



IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

ratio of the total improvable vapor loss amount occupying a total unknown vapor amount Qx as a difference between the total vapor supply amount Qi and the total necessary vapor amount Qo as an improvable unknown vapor ratio Kts. Alternatively, it is possible to calculate the unknown vapor ratio Kx and the unknown vapor ratio after the improvement Kxx. Alternatively, it is possible to calculate the unknown vapor ratio Kx and the apparent unknown vapor ratio after the improvement Kxx.'.